PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08-015506

(43)Date of publication of application: 19.01.1996

(51)Int.CI.

G02B 5/02

(21)Application number: 07-051619

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

10.03.1995

(72)Inventor: NIKORASU JIEI FUIRITSUPUSU

DEIBITSUDO EZURA

TSUE WAN

(30)Priority

Priority number: 94 9404723

Priority date: 10.03.1994

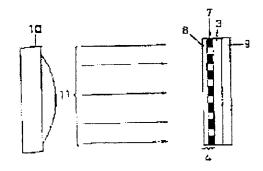
Priority country: GB

(54) PRODUCTION OF DIFFUSER AND DIFFUSER

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a diffuser provided with a microlens array which is small in the size of individual microlenses and has some randomness.

CONSTITUTION: An optical mask 4 is produced by recording speckle patterns on a recording medium 7 and the diffuser is produced by using the optical mask. A photopolymerizable material 3 is arranged adjacently to the optical mask 4 and is exposed to a light source through the optical mask 4. The graded index microlenses are formed on the photopolymerizable material 3 in correspondence to the speckle patterns.



			, ,
			<u>-</u> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
) ()			
		-47, -22	

日日本宣传新史 JP 日本 日公開特許公報 日本 日本新士類公開番号

特開平8-15506

45 公開日「平成8年 1996 1月19日

€: ::::::: *

宁内整理番号 識別記号

Ξ:

技術表示意所

0003 5:00

審査請求 未請求 請求項の数14 〇L 《全7頁

(01)出願番号

特願平7-51619

(22)出題日

平成7年《1995》3月10日

(31)優先権主張番号 9404723.0

(32)優先日 (33)優先権主張国

1994年3月10日

イギリス(GB)

イギリス国 レスター エルイー1 9ビ ーエイチ, ザーゲイトウェイ, ドーモント フォード ユニバーシティ, サイエンス

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

アンド エンジニアリング リサーチ セ

ンター (番地なし)

シャープ株式会社

(02)発明者 ニコラス ジェイ. フィリップス

(74)代理人 弁理士 山本 秀策

(51) 出願人 0000000049

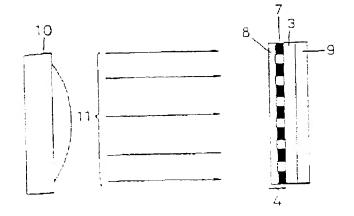
最終頁に続く

(54)【発明の名称】ディフューザ製造方法およびディフューザ

(57)【要約】

【目的】 個々のマイクロレンズの大きさが小さく、あ る程度のランダムさを有しているマイクロレンズアレイ を備えたディフューザを提供する。

【構成】 記録媒体でにスペックルパターンを記録する ことにより、光マスク4を作製し、これを用してディフ ューザを製造する。光重合性材料3を光マスウ4に隣接 して配置し、光マスク4を通して光顔に露光する。スペ ッカルパターンに対応して光重合性材料 3 に勾配屈折率 マイクロリンズが形成される。



【特許請式二範囲】

【請求項:】 記録媒体にスペークルパターンを記録して光マスケを作製する工程と

部元マストを光重合性材料に隣接して配置する工程と、 計光重合性材料を設定マスクを通して限制することにより都光重合性材料に温折率を変化させ、スペークルパターンに対応する勾配阻折率したがを形成する工程とした 包含するディフェーサ製造方法。

【請求項目】 前記代重合性材料は、該元重合性材料の 照射領域に向かって隣接する非明射領域から指散するモ 10 イマーを有し、前記明射上該光ママルのマボッかんパタ 一)の透明な形状のサイアとによって、試モイマーが前 記句配屈折率レンドの各次の横方向の広がりの実質的な 部分の距離を拡散する、請求項1に記載のディフェーザ 製造方法。

【請求項3】 前記実質的な部分は少なくとも手分である。請求項2に記載のディフューザ製造方法。

【請求項4】 前記勾配記折率リンスの各々の横方向の広かりは、2から3マイクロメーター以下の程度である、請求項2または3に記載のディフューザ製造方法。 【請求項5】 前記勾配屈折率リンズの各々の横方向の広がりは、2マイクロメーターより短い、請求項4に記

【請求項6】 前記勾配屈折率リンスの各々の横方向の 広がりは、1マイクロメーターより続い、請求項5に記 載のディフューザ製造方法。

載のディフューザ製造方法。

【請求項7】 前記アプラウルバターンは光学的拡散アクリーンを用いて供製される、請求項1からものいずれか1つに記載のディフェーサ製造方法。

【請求項3】 前記光学的拡散アクリーンは磨りカラア 30 定される。 スクリーンである、請求項でに記載のディフューザ製造 【0005 方法。 392 868号

【請求項3】 前記光学的拡散スクリーンは非対称である。請求項7または3に記載のディフューザ製造方法。 【請求項19】 前記光重合性材料は学外光により照射される。請求項1から9のいずれか1でに記載のディフューザ製造方法。

【請求項11】 前記記録媒体はハロゲ、化銀を有する。請求項1から19のいずれか1つに記載スディアュー

で数遣方法。

【請求項10】 前記記録媒体は「102層に形成された プトンジアト層を有する、請求項1から1100ずれか 1つに記載のディフューサ製造学法。

【請求項13】 前記記録媒体は前記でパッケルのター、に対応する表面にリーフのパター、を有りており、これにより、訪記録媒体が前記元素合性材料と接触しているとき、前記勾配置折率、リスと数合して「法面にリーフのパター」が設光重合性材料に形成される。護工項1から1200で進れか1つに記載のディアューが製造方法。

【請戈項14】 請求項1から18のいずれか1つに記載のディフューザ製造方法によって製造されモディフュ

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ディフューザを製造する方法、およびこの方法によって製造されるディアューザに関する。

[0.6.6.2]

【従来の技術】一般に、ディフェーサは、入射光を適切な方法で偏向させる物体であって、これにより、観察者が自分のいる地点でその物体のいかなる部分からの光でも見ることができる物体によって形成される。ディフューザの1つの例を図1に示す。このディフューザはスクリーン1、およびスクリーン1の一方の表面に形成されたマイクロレンスののアレイよりなる。各マイクロンスのアレイよりなる。チィフューザの平面に近い一点で集光または偏向する。観察者はマイクロ上、スコのアレイを拡散表面としてみる。

20 【0003】英国特許公開公報第2 261 100号には、表示装置のハック照明のための散乱膜ディフューザが開デされている。表示装置の照明状態をシミュレートすることにより陰画が作製され、陽画は、接触露光によって陰画から写真術により作製される。

【0004】英国特許の銀色報道の tis R6R号には、干渉パターンを記録することによって回折位相構造(diff faction phase structure)を形成する方法が開示されている。重合性液体中の誘電性マイクロオールがパターンに従って空間に分散し、次に紫外線光重合によって固定すれる。

【0005】欧州特許公開公朝第0408396号および第0 322863号には、ディフェーザを作製する類似した方法 が開示されている。光を散乱させる透過性パターンを育するマスクを通して光重合性高分子・コオトポリマー) に光を照射することによって、光制御プレートが作製される。この光散記パター)は、適切なマスクを通してカラスストすることによって作製される。この方法により、入射池を異なる角度で拡散させる異なる領域を有するディフューサを作製すること 40 ができる。

【カルコス】欧州特許公開企報第0 258 994号には、規則的なアイケコン、アアレイを作製するための元重合性高等子を用いた方法が開デされている。

【そうとう】大国特許萬紅36年の号には、光マスクを用いずにディフェーナを形成する方法が関係されている。アハッカンパターンをイロゲン化銀平に形成し、このパターンから、脱色を含む処理を行った後、屋折本が流行するディフェーカが形成されるか、この屋折率に変化は極くているい。こロゲン化銀の不透明領域では光出のの低下するため、得られるディフェーかは比較的非効

率である。星折率の変化が限られているため、光拡散は 比較的いさく、このため、拡散で率は実質的に低下し、 鞋かられれて観察される。

【3005】光重台生高分子材料とは、輻射されると光 学特性および/または化学特性が変化する材料である。 このような性和物質としては、日刊F180名はびHR 9831などのデュポン (Disto): 社によって製造され る一連の可変屈折率モノマーがある。光重合性高け子は 初めば重合されていない。玄白(a)に示すように、例 賢の光等の輻射1.1によって照射されると、光重合性高 分子3の照射された領域10に部分的な重合が起こる。 隣接した非異射領域から照射領域にモノマーが拡散し この結果、光重合性高分子の取射領域にまたがって選択 率がかなり変化する。

【6009】照射領域にまたから囲紆率の変化により、 勾配団折率(grides index:(-RIN) レンズが形成さ れる。光重合性高分子に形成されるGRINレンスの特 性については、Proc. SFIE, Vo., 175 1、1992 33~46 真に記載されている。

【前010】例えば、表面にレリーフを有するマスクを 用いて照射を行うと、光重合性材料の照射により、照射 領域内の材料の厚さもまた変化し得る。このような厚さ の変化によりGRINによる集光を補う別の集光メカニ ズムが提供され得る。

【0011】温折率(およびおそらくは厚さ)の夜化が 得られた後、通常は、光電合性高分子に強度のブランケ ット照射を行う。これにより光重合性高分子は完全に重 合され、屈折率および厚さの変化が「固定」される。

【0012】光重台性高分子を選択的に照射することに、30 よってマイクロレンズアレイよりなるディフューオを作 製する方法は、欧州特許公開公報第)294-100号および Proc. SPIB. Vol. 1544, 1991, 1 $\sigma \sim 3$ 1頁に記載されている。特付田面の田 3に示すよ うに、これもの方はは、マスタ4を通じて光重合性材料 3 を照射する工程を包含する。

【3013】1つの従来の方法では、マスタは、高解像 度のプリンクを用って基板上にドットパターンを印刷す ることにより作製される。次に基板を処理して、黒の背 する.

【00014】英国特許公開公報第0106 909号には「光 **重合性材料にはまてパンンズを形式することによってデ** ノフューザを作動する方法づ関于されている。ほぼ規則 節なノンガロアレイが、フレガの相対的な位置決めは幾 分が無秩序の状態で形成される。この方法の難点は、こ のように無秩序化された規則的なアンイは、どの程度の 構度であっても作製することは非常に困難なことであ ま。他重合生材ればアフトを通じて明射され、また。こ 照射領域から照射領域へ拓散し、10~30マイクログ ーター程度の直径を有するGRINシンでが形成され ÷ :

101151

【発明が解決しようとする課題】団把率の変化が一定で あれば、GRINシンズは、直径がしち山と騒度が大き くなる。さらに、形式されるGRINシンズに対して モノマーは、シンズの直径の実質的な部分に等しい距離 にわたって拡散しなければならない。預制模域が大きす えば13~160~mの厚さを有する光重合性材料30~1) ぎもと、真のGR1NVLズ、屈折率がその形式の中央 に向かうに逆って緩やかに増加する)を形成するために モノマーを主分に在散させることかできなべ。 従って 上記の英国特許公開工報第2008978号に示唆されたよ うな $_{8}$ 10 \sim 3) マータロメーターの直径を有するマイ グロシンプを作製することは不可能である。

【り、16】上記の選出により、レンズを小古り、例え は、しゃ3ヵmの直径にするのが望ました。しかし、マ イ クロシンズの大きさがいまければいさいほど。マスク の製造が困難になる。

20 【0): 7】例えば 光のスポットを基板に集せするこ とによりでスカの記録を行う従来技術の方法では、スポ ・トラスきさがんさくなるに従って焦点浸度がすさくな き。 大きなマスクを心要とする場合、極めて小さいスポ 下を得るためには自動集点の方法を用いることが必要 となり得る。その上、極上のスポットよりなる大きなア レイを書くのは極めて進行の遅いプロセスとなる。

【0018】さらに「得られるディフューザに集光的な 回折現象が住じるのを防ぐために、マスクの穴のパター 」にある程度のランタムさをもたせる心質がある。マス 片製造プロセスにこのランダムさを取り入れる必要があ まためプロセスが複雑になる。この問題はマイクロシン ざた小さくなるに従って深刻になる。

【() 1 9】本発明はこのような現場に鑑みてなされた ものであり、その目的とするところは、傷々にマイプロ シンスの代きさがんさく、ある程度のランダムさを有し ているマイクロシンズアレイを備えたディフェーサの製 造た法、及びディニーザを提供することにある。

[((3 3]

【課題を解決するための手具】本発明のディアューザ製 景に透明なアパーチャーのアレイを有するマスクを作製。43、造力法は、記録媒体にスペックルパターンを記録して光 マスタを作製する工程と、該元マスタを光重さ性材料に 講接して配置する工程と、該元重台性材料を该光マスク を通じて照射することにより数光重合性材料の思折率を 変化させ、スペックンパターンに対方する勾配国援率ン ンズを形式する工程とを包含しており、そのことにより 上記目前を達成する。

【2.2.2.2.1】前記光重合性材料は、該光重合性材料の照 射領域に向かって隣接する非昭射領域から拡散するモリ サーを有し、囲動 および設元マネガスネベッカーペタ た公頼の子接するところでは、モリマーゼ、構接した期 デニーンの透明な形式のサイクは、数モノガーが前記な配置 折率レンズの各々の横方向の広かりの実質的な一部分に 等しい距離たけ拡散するようにされていてもよい。

【・000】前記集質的な部分は多なくともキ分であっ 742...

【りりこ3】前記勾配屈折率し、スの各々の横方向に広 がいは、こ~3マイクロメーター以下の程度であっても

【りり24】前記勾配屈折率ししての各々の横方向で広 がりは、2マイクロメーターより短くでもよい。

【0025】前記与配居折率にしての各々の横方向に広。10。 がりは、1マイクロメーターより短くてもよい。

【りりこ6】前記スペッカルバターンは光学的拡散スク リーンを用いて作製されてもよい。

【りり27】前記元学的拡散スクリーには磨りガラスス クリーンであってもよい。

【0025】前記光学的拡散アカリーには非対称であっ てもよい。

【0089】前韶光重合性材料は紫外光により照射され

ちよい。

【りり31】前記記録媒体は自己厶層に形成されたホト レジスト層を有していてもよい。

【0000】前記記録媒体は前記スペックにパター」に 対応する表面レリーフのパターンを有しており。これに より、該記録媒体が前記元重合性材料と接触していると き、前記勾配屈折率レンスと整合して、表面レリーでの パターンが訪光重合性材料中に形成されてもよい。

【りり33】は発明のディフューサは、前記方法のいず れかりつによって製造され。そのことにより上記目的を、30 めに用いることができる。 達成する。

[9034]

【作用】は発明のディアューが製造方法では、まず、記 銀媒体にアペックルバターンを記録して光マスタを作製 する。続いて、この治ママクを元重合性材料に隣接して 配置し 光重合性材料を光マスクを通して照射すること により光重合性材料の屈折率を変化させ、アデップルパ ターンに対応する勾配選択率シンプを形成する。

【リリ33】七重台進材料は、照射された領域に向わっ る。元マスクのスペークスパターンの透明な形状の力を さは、モイマーが勾配屈折率レンプの各々の横方向の広 がりの実質的な一部分に等しい超離だけ拡散するように され、そ。

【 3.6】元マスのは高いコントラストを有すると有 利である。そうすれば、モノマーをより良好に拡散させ る商い勾配度が提供される。

【 0 2 7 】 スペットルバケー マスタを形成し、これ を通じて光重合性材料を照射することによって、形状の 大きさが小さく、それゆえに勾配屈折率レンズのランダーが、紫外光心光原である。これによって、光重当性材料は同

上なスペックルパターンをモイマーの移動によって形成 することが可能になる、マスクを形成することができ る。スペ_とクルパターでは、E、日echt、Cませ、 でき、1957 - 593~3頁に記載されているよう に、コピーレント七弾が拡散表面から散乱するとき形成 されるものであり、本質的にランダムである。従って、 ディフェーサでに集光的な回折は防止される。スペック ルバターンは、使来の集光光学装置を用いて得られるも のよりも引さい形状を作製することができる。

【0038】モイマーは、勾配屈折率レンプの各々の横 方向の広がりの少なてとも半分の距離だけ拡散する。と れを実現して効果的な勾配屈折率レンプを作製するため には、レンスの各々の横方向の広がりは、とへるマイク ロメーター以下の程度であるのが好ましい。各レンプの 横方向の広がりは好ましては2マイクロメーターより短 く、より好ましくは1マイクロメーターより短い。

【0039】1~2マイドロメーター以下の程度の透明 な形状を有するスペックルパターンは容易に記録され 得、これにより、光重合性材料の照射を制御するために 【0030】前記記録媒体は八口ダレ化銀を有していて、20、用い得るマスクを形成することができ、このことによ り。光重合性材料に含有されるモイマーは光力に拡散し て、勾配屈折率レン河を形成することができる。これに より、不透明の領域がないせいで効率が高く(すなむ も、光損失が比較的低了。、幅広い分散特性を有するデ イフューザを作製することができる。比較的小さいアイ りたらればれた透明な形状を有するマスクを形成し、こ のマアクを通した照射を制御することにより しょうは 効率良くまた比較的迅速に形成され得る。従って、この 方法は極めて質の高いディフューザを大量に生産するた

> 【0040】マスクの穴に大きさを、マペート、パター シを形成するために用いる光の波長と匹敵する程度にす ることができる。さらに、アペッパスパターでは無制限 の窓間的な広がりを有するため、マスクを作製するため にアペックがパター、を用いることにより、マアガ製造 中に高精度の集池を行う心要がない。

【りり41】アポーケルパターがばロモーンパケ地の風 射関的は透過のいずもお記まって作製することができ る。アインケスパター、は七学的拡散アクリー)、例え 丁隣接する非理針領域から拡散するモンマーを含んでは、40、は、着りガラススカジーンを用いて体製される。また。 元学的拡散でクリー、は非対称である。このようなでき 一くでは、一つの方向の平均サイブが、その迂向に直 漢する方向の平均サイズとは異なるスペックルを有する スペーン いパター・は3件製される。これは、得られるマ アクロアバーチャーが異方的であることを意味する。こ のようなアスクは、ディフューザが、例えば、横方向に 広い視野を有する必要はあるが垂直方向に広い視野は必 要ない場合に有用できる。

【 り;2】光重い性材料を開射するのに明いる光源は

根元に感力する染料を含有する必要はなく、徒って可視 光スペクトラムのほどもとで実質的に透明および無色で あり得るという利点が得られる。しつし、光重台性材料 が可視光スペクトラムに感応する場合は可視光を用い得 Ž.,

【10143】記録媒体は、スペックな『ターンに対応す』 る表面ンザータのパターンを有していてもよい。これに、 より、記録媒体が光重合性材料と接触するとき、勾配団 折率リンズと整合して表面メリーアのパターンが光重命 性材料中に引成されるのが可能となる。 照射に誘発され、 12 「記録される。記録媒体でに形成されたスペックルは下記 たモリアーに移動により、スペックリバターシに対応す。 る表面レリーフが形成されることが多い、記録媒体の表

 $\Im x = \Im y = \lambda . \Im \Delta$

主 1)において、ハ、は光6の皮長、ははスケリーン。 もと記録媒体でとの間の距離、およびLはスクリーン3 の巻きおよび幅でする。

【(でも7) スペックルバターンは、コピーシント波の 静止干渉パターンである。このような干渉パターンは空 聞的な広がらが大きいため、スペークルコターンは、ス タサーン3と記録媒体でとの間の距離はにかかわりなく。20~クリーン3~を用いる以外は同4~a/ に示した方法と 記録媒体でにはっきりと形成される。

【0048】記録媒体では透明基根8に取り付けられて おり、例えば、ハロゲン化銀とゼラチンとの層である が、または、ガラス基板上のクロムに形成されたオトン

$$\delta x = i, d./L,$$

 $\delta y = \lambda, d, L,$

スペックルは異方的であり、異方的なアペーデャーが多 ンダムに配置されたマスケが作製される。

【(り51】ディフューザを形成する方法を図るに示。 す。上述のように製造されたマスケまを「基板9上に支」の「たアグファ(Agia)のGavaertミリマスク 排された光重合性材料 3 σ 層と接触させて配置する。次 にマスキを、方向性を持った光ではあるが必ずしもコヒ 一10~光ではない光11の光源10を用いて照射す る。マスタ4のアパーチャーに対応するジン式が光重台 性材料のに形成される。

【りしきら】マスタ4が平坦でない場合 照射によるモ こヤーの移動の結果として、光重合性材料3は表面にす 1 一つを形成する。例えば、現像、脱色または固定プロ 七スの聞に、たロゼン化銀のマスクに表面レジーフが形 或され得る。この場合には、集光は、照射領域にまたが、4。 る鼠肝さのがなりの程度の変化および厚さの変化の関立 により行われ得る。

(1.18日)しか。 マスカが平温であれば 七重点を 第分子はマスタと基板との間に挟まれるため表面シェー つをやさない。この場合。モメヤーの移動はある程度阻 害され得る。唯一の集光、カニマムは、照射領域をまた。 て田村本のわなり程度の変化である。

【↑~94】の「下て、上記方法により、実際はティニュ 一ぜな形式した例を子すい

【こうぎき】 暫に力力する サービン 変すしていしゃせか!

変レッープによって空間が提供され、これにより、この 表面ングーニが光重当性材料中に形成され得る。

100441

【実施例】本発明を図面を参照しながら説明する。

【1.14日】図4、日、はロベーカン『タージを作製す るこつの方法を示す。正方形の磨りだまススクバーン8 を、例えばレーザ光線を拡充レジズおよびコリメータに 通すことによって形式されるコピーレント光子によって 照射する。スペックルパターンが作製され記録媒体でに の式(1)によって与えられる平均サイズを有する。 [0046]

ジスト層であり得る。記録媒体でにスペックルパターン を記録し、続いて記録媒体を山知の方法を用いて処理す ることにより、黒の背景に透明なアパーチャーのアッイ をランタムに配置したマスクは対形成される。

【0.049】図4(5)はスペックルバターンを作製す る別の方法を示す。この方法は、長方形の磨りだうスス 同様である。ダペックルの平均サイズは下記の2つの式 によって与えられる。

[0 0 5 0]

(2)

3)

らの波長514mmの光で照射した。得られるスペック ルパターンを「ガラス基板によって支持され、磨りガラ ススポリーンからじゃ3センチメートの難して配置され (MIII(mask)材料からなるシートに記録し <u>ئ</u>ـ ہ

【5m56】ミリマスク材料のシートを、先ず、アグフ マ現像装置タイプG2840で現像した。次に、通常の アグファの方法に従って矢転処理した。これにより、黒 の背景に透明なアパーチャーがランダムにアレイしてい るマスカを作製した。

【1057】次に、マイラー Mylsr 製の基模に よって支持された事さ100kmのデュザン社の光重台 他高分子日氏を1800シー(をマスカに積置した。次 にマストを改長368mmの袋外元に露元して、積層ポ マーにマイカロレンス 勾記団折率リン式の微細構 遺しなアッドを形成した。

[0] [8.8]

【発明の効果】本発明によると、1~1マイガロルータ 一のオーターの透明な形式を容易に記録することがで - 毛重台性材料の期射を制御するために これにはます。 用いられるマスクを形式することが可能である。糖い て、たんようなマスクを用いて光葉合性材料を照射する ことにより、も、ポッスニャは枯齢し、薄の 99 1 11 2

10

ンズアレイ(マイクロレンブアレイ)が形成される。こうして得られるGRINレンズは、不透明な領域を有していない。このため、高効率で、かつ高分散特性を有するディフューザを得ることができる。

【0059】このように、本発明によると、サイズの小さい複数のマイクロレンゴがある程度のランダムさを有してアレイされているマイクロレンスアレイを効率的に、かつ比較的迅速に作製することができる。従って、本発明の製造方法は、非常に高品質のディフューザを大量生産するのに有利である。

【図面の簡単な説明】

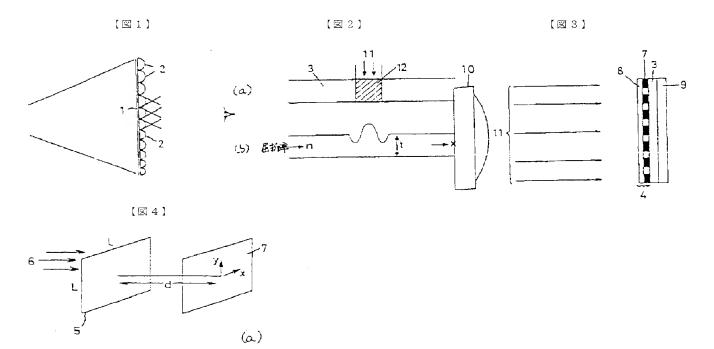
【図1】ディフューザの概略区。

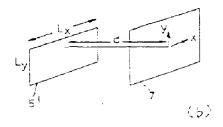
【図2】 (a) は光重合性材料が照射される様子を示す概略図。(b) は(a) の光重合性材料の、照射後の屈折率と厚さを示す。

【図3】ディフューザが作製される様子を示す蝦略図。 【図4】(a) および(b) は各々、スペックルパター ンを作製する方法を示す。

【符号の説明】

- 1 スピリーン
- 2 マナクコレンズ
- 3 光重台性材料
- 4 *---
- 5 ガニススクリーン
- 10 7 記錄媒体
 - 8 透明基板
 - 9 基板
 - 10 光源
 - 1 1 🚈
 - 12 照射領域





プロントページの特色

11.発明者 ディビ ド エズラ

イキ、マ国・オーエックスココードアール エル、オ、ケスフォードシア、フォー・シ グフォート・プライトフェル・オニー トウェル、モンクス・ミード・19

13.発明者 ジェーマン

中華人民共和国 2:5006. ソシュウシズ ストリート 1. ソシュウ ニニ バーシティ、シーザー リサーチ インスティテュート

	•